

05;06.2

ЭПИТАКСИАЛЬНЫЕ СЛОИ ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ НИТРИД ГАЛЛИЯ — НИТРИД АЛЮМИНИЯ: ПОЛУЧЕНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

© А.М. Царегородцев, А.Н. Ефимов

В последнее пятилетие нитрид галлия выдвинулся в бесспорные лидеры среди материалов для оптических устройств коротковолнового диапазона. Для многих приборов на базе GaN требуется создание гетеропереходов с участием твердых растворов. Твердые растворы в системе GaN—AlN представляют и самостоятельный интерес для оптических устройств в диапазоне 0.24–0.28 мкм [1]. Однако свойства твердых растворов $Al_xGa_{1-x}N$ изучены недостаточно. В частности, практически не исследованы ориентационные соотношения в системе слой—подложка. Данные о параметрах решетки твердых растворов $Al_xGa_{1-x}N$ также отрывочны и противоречивы. Так, в работе [2] наблюдалось сильное положительное отклонение от закона Вегарда для порошка твердого раствора эквимолярного состава ($Al_{0.5}Ga_{0.5}N$). Авторы работы [3], напротив, наблюдали значительное отрицательное отклонение от закона Вегарда при изменении с-параметра от состава твердого раствора $Al_xGa_{1-x}N$. Измерения проводились на эпитаксиальных слоях, полученных молекулярно-лучевой эпитаксией. При этом состав определялся на слоях, выращенных на (111)–Si, а свойства — на слоях, осажденных на (0001)– α – Al_2O_3 . Данные о толщине и однородности состава слоев в работе [3] отсутствуют.

В настоящей работе проведено исследование структурных характеристик эпитаксиальных слоев твердых растворов $Al_xGa_{1-x}N$, полученных хлоридно-гидридным методом.

Эпитаксиальные слои твердых растворов $Al_xGa_{1-x}N$ во всем диапазоне составов получали методом газофазного осаждения в хлоридно-гидридной системе (Al — Ga — HCl — NH_3 — Ar), которая ранее применялась для эпитаксии нитрида алюминия [4]. Использовался горизонтальный реактор проточного типа с резистивным нагревом. В зоне источника в результате реакции хлористого водорода с металлами (Al и Ga) образуются соответственно трихлорид алюминия и монохлорид галлия. Хлориды смешиваются затем с аммиаком, и гомогенизированная смесь подается с помощью газа-транспортера аргона в зону роста,

Ориентационные соотношения в гетеросистеме
 $\text{Al}_x\text{Ga}_{1-x}\text{N}/\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$

Плоскость $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$	(0001)	(11̄20)	(01̄12)	(10̄14)
Направление $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$	[̄100]	[0001]	[0̄111]	
Параллельная плоскость слоя $\text{Al}_x\text{Ga}_{1-x}\text{N}$	(0001)	(0001)	(11̄20)	(0001)
Параллельное направление слоя $\text{Al}_x\text{Ga}_{1-x}\text{N}$	[̄12̄10]	[10̄10]	[0001]	

где взаимодействие хлоридов с аммиаком при $T \sim 1300\text{ K}$ приводит к эпитаксии твердого раствора $\text{Al}_x\text{Ga}_{1-x}\text{N}$ на подложках. В качестве подложек использовались пластины лейкосапфира ($\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$) кристаллографических ориентаций (0001), (11̄20), (01̄12), (10̄14). Управление составом твердого раствора производилось путем варьирования соотношения парциальных давлений хлоридов галлия и алюминия, подаваемых в зону роста. Толщина слоев составляла от 2 до 20 мкм при скоростях роста 0.1–0.7 мкм/мин.

Все полученные слои $\text{Al}_x\text{Ga}_{1-x}\text{N}$ имели структуру вюрцита. Ориентационные соотношения в гетеросистеме $\text{Al}_x\text{Ga}_{1-x}\text{N}/\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$, определенные методами Лауэ (на просвет) и рентгеновской дифрактометрии, представлены в таблице. Ориентационные соотношения не зависели от состава твердого раствора и идентичны тем, которые установлены ранее для гетеросистемы $\text{AlN}/\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ [5]. Для эпитаксиальных слоев, выращенных на (10̄14)– $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$, уверенно установить азимутальное соотношение не удалось из-за невысокого кристаллического качества слоев. Однако наиболее вероятно, что оно имеет вид $\langle\bar{1}2\bar{1}0\rangle\text{Al}_x\text{Ga}_{1-x}\text{N}/\langle20\bar{2}1\rangle\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ [6].

Для определения состава твердого раствора по основным компонентам использовался метод рентгеноспектрального микроанализа (микроанализатор MS-46). При зондировании с поверхности от разных точек образца относительное стандартное отклонение интенсивности GaK_α -линии не превышало 2%. Эти вариации могут быть отнесены на счет статистической природы рентгеновского излучения. Исследования однородности состава по глубине слоя, проведенные на косых шлифах (угол 0.5–1°), показали присутствие у гетерограницы переходного, неоднородного по составу слоя толщиной 0.3–3.0 мкм, за которым следует значительно более толстый слой практически постоянного состава (рис. 1). Все слои, выращенные на (0001)– $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$, имели переходный слой, обогащенный нитридом галлия по отношению к последующему слою постоянного состава. В то же время в

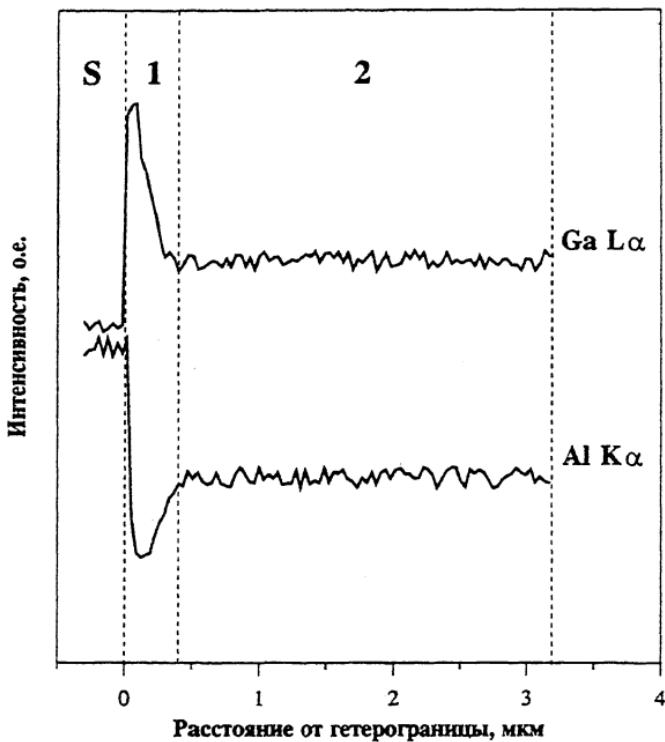


Рис. 1. Концентрационные профили по толщине гетероструктуры (0001) Al_2O_3 /(0001) $\text{Al}_{0.49}\text{Ga}_{0.51}\text{N}$. S — подложка; 1 — переходный слой; 2 — слой постоянного состава.

слоях, которые осаждались на пластины лейкосапфира других ориентаций, а именно: $(11\bar{2}0)$, $(01\bar{1}2)$, $(10\bar{1}4)$, наблюдались как переходные слои, обогащенные нитридом галлия, так и слои с избытком нитрида алюминия. Наиболее вероятными причинами возникновения такого типа неоднородности состава могут являться изменение состава газовой фазы на начальных стадиях роста и(или) катализитическое влияние подложки на состав твердой фазы [7].

Основная сложность при исследовании зависимости параметров решетки от состава твердого раствора заключалась в интерпретации данных рентгеновской дифрактометрии неоднородных по составу образцов.. Для этих исследований были отобраны слои, выращенные на базовой плоскости лейкосапфира, имевшие толщину 2–20 мкм и минимальную протяженность переходного слоя (0.3–0.6 мкм). В качестве состава твердого раствора, ответственного за максимум интенсивности рентгеновского отражения, принимался состав, измеренный методом рентгеноспектрального микроанализа с поверхности образца (область 2 на рис. 1). Для прецизионного измерения параметров решетки твердого раствора использовалось кобальтовое излучение (CoK_α и CoK_β), дающее наибольшие брэгговские углы. Па-

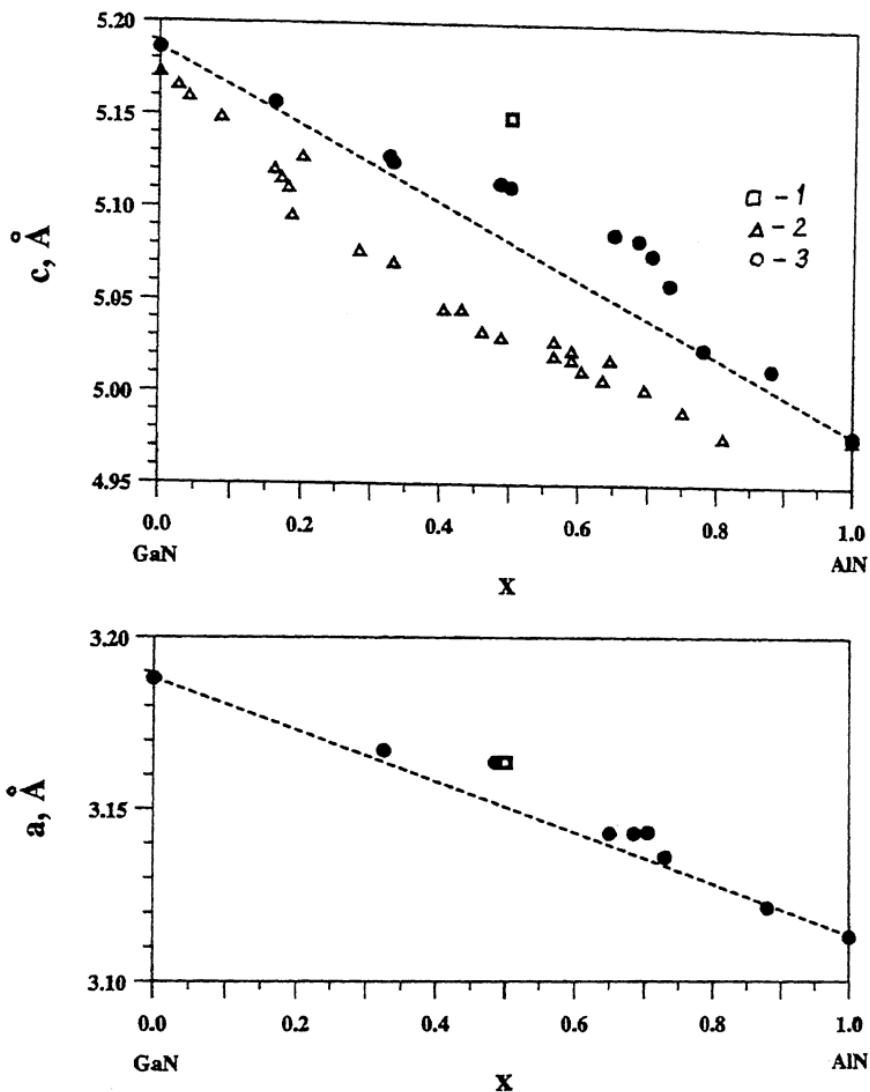


Рис. 2. Зависимости параметров решетки (c и a) твердого раствора $\text{Al}_x\text{GaN}_{1-x}\text{N}$ от состава (x): 1 — данные [2]; 2 — данные [3]; 3 — наши данные.

параметр c определялся по положению (0006)-рефлекса (излучение CoK_β). При этом использовались как метод Бонда, так и метод внутреннего эталона, где рефиром служил рефлекс от подложки лейкосапфира. Независимые измерения параметра a эпитаксиальных слоев базовой ориентации проводились на CoK_α -излучении по методике, совмещающей дифракцию с полным внешним отражением. При этом дифракция от {303̄}-плоскостей, перпендикулярных поверхности слоя, осуществлялась при скольжении падающего луча вдоль поверхности. Для исключения ошибки, вызванной эксцентриситетом, данная методика совмещалась с методом Бонда.

Зависимости параметров решетки твердого раствора $\text{Al}_x\text{Ga}_{1-x}\text{N}$ от состава представлены на рис. 2. Там же показаны результаты работ [2,3]. Видно, что зависимости параметров решетки твердого раствора $\text{Al}_x\text{Ga}_{1-x}\text{N}$ от состава, полученные в настоящей работе, характеризуются значительным положительным отклонением от закона Вегарда, особенно в области составов от $x \sim 0.3$ до $x \sim 0.7$. Чтобы убедиться, не связано ли это с методической ошибкой при определении значений параметров решетки неоднородного по составу образца, были сняты рентгеновские дифрактограммы от образцов после изготовления на них косого шлифа с углом $0.5-1^\circ$. Типичная дифрактограмма от шлифа показана на рис. 3. Удаление при изготовлении шлифа значительной части поверхностного слоя постоянного состава увеличило относительный вклад в интенсивность отражения переходного слоя. Пик 2 на рис. 3, который мы связываем с областью постоянного состава (область 2 на рис. 1), практически не изменил своего положения после изготовления шлифа. В то же время в области меньших углов появился пик 1, который следует отнести к переходному слою (область 1 на рис. 1). Из рис. 3 отчетливо видно, что экспериментально обнаруженное отклонение от закона Вегарда не является результатом наложения пика 1 на пик 2.

Существенная нелинейность зависимости параметров решетки от состава в эпитаксиальных слоях твердых растворов $\text{Al}_x\text{Ga}_{1-x}\text{N}$ не может быть также следствием деформаций, возникающих из-за несоответствия решеток и коэффициентов термического расширения слоя и подложки. Эти эффекты должны действовать противоположным образом на параметр a и параметр c , тогда как эксперимент показывает одинаковый характер нелинейности для обоих параметров решетки. Кроме того, деформации, связанные с несоответствием решеток слоя и подложки, сосредоточены вблизи гетерограницы и в значительной мере должны релаксировать.

Причиной наблюдаемого эффекта может являться значительная доля межузельных атомов, которые должны расширять решетку. Известно, что в образцах GaN сильное завышение значений параметров решетки (на ~ 0.4 и $\sim 0.3\%$ для c и a соответственно) коррелирует с высокой концентрацией межузельных атомов, определенной методом канализования [8,9].

С другой стороны, следует отметить, что в общем случае выполнение закона Вегарда является скорее исключением, чем правилом (см., например, [10]).

Дальнейшие усилия по совершенствованию технологии необходимы для получения однородных по составу эпитаксиальных слоев твердых растворов $\text{Al}_x\text{Ga}_{1-x}\text{N}$ для уточне-

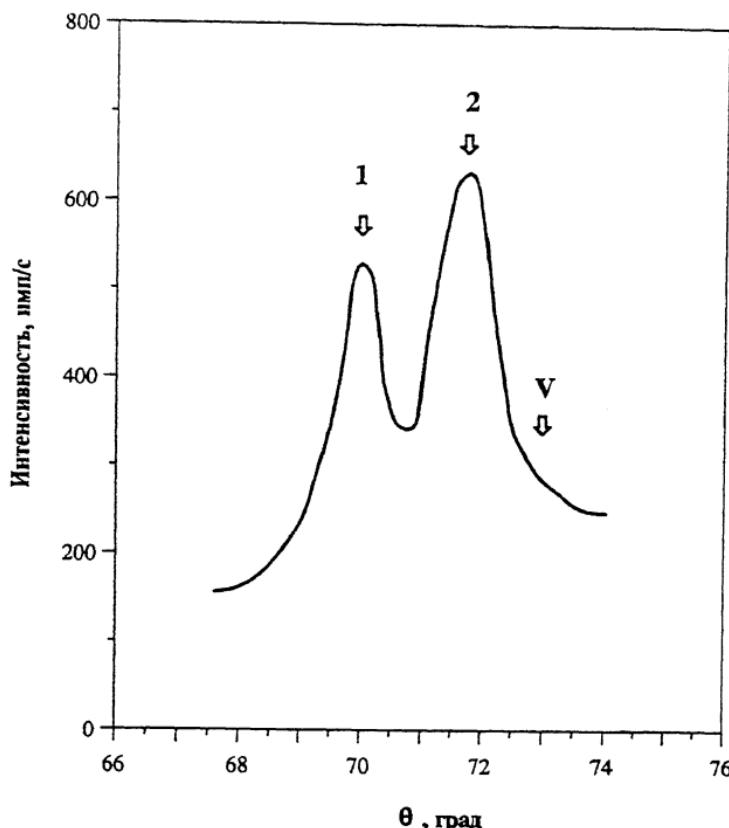


Рис. 3. Дифрактограмма от косого шлифа эпитаксиальной структуры $\text{Al}_{0.49}\text{Ga}_{0.51}\text{N}/\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$. Рефлекс 0006, CoK_β . Пики 1 и 2 соответствуют областям 1 и 2 на рис. 1. Стрелка V указывает угол, соответствующий закону Вегарда.

ния зависимости параметров решетки от состава. Вместе с тем следует отметить, что результаты, полученные в настоящей работе, являются, как нам представляется, наиболее достоверными на настоящий момент.

Авторы выражают благодарность М.А. Чернову за помощь в проведении рентгеновских измерений.

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (95-02-04148-а).

Список литературы

- [1] Strite S., Morkoc H.J. // Vac. Sci. Technol. B. 1992. V. 10. N 4. P. 1237–1266.
- [2] Лютая М.Д., Бартницкая Т.С. // Методы получения, свойства и применение нитридов. Киев: Наук. думка, 1972. С. 365–369.
- [3] Yoshida S., Misawa S., Gonda S. // J. Appl. Phys. 1982. V. 53. N 10. P. 6844–6848.

- [4] Lebedev A.O., Melnik Y.V., Tsaregorodtsev A.M. // Silicon Carbide and Related Materials. Inst. Phys. Conf. Ser. N 137. Bristol and Philadelphia: Inst. Phys. Publishing, 1994. P. 405–407.
- [5] Bugge F., Efimov A.N., Pichugin I.G. et al. // Cryst. Res. Technol. 1987. V. 22. N 1. P. 65–73.
- [6] Efimov A.N., Lebedev A.O. // Thin Solid Films. 1995. V. 206. P. 111–117.
- [7] Сурис Р.А., Чернавская О.Д., Чернавский Д.С. 6-я конф. по процессам роста и синтеза полупроводниковых кристаллов и пленок. Тез. докл. Новосибирск, 1982. С. 174–175.
- [8] Lagerstedt O., Monemar B. // Phys. Rev. 1979. V. 19. N 6. P. 3064–3070.
- [9] Linden M., Ejder E., Hellborg R. // Phys. Stat. Sol. A. 1978. V. 45. N 2. P. K167–K170.
- [10] Ferraris G., Angela M.F. // Rendiconti della Societa Italiana di Mineralogia e Petrologia. 1971. V. 27. N 1. P. 105–147.

Физико-технический
институт им. А.Ф. Иоффе РАН
С.-Петербург

Поступило в Редакцию
22 ноября 1996 г.